

「イオンミリング装置」の紹介

○ 本装置は、観察・分析用試料の表面や断面を少ないダメージで加工・調整できます。



イオンミリング装置の概要

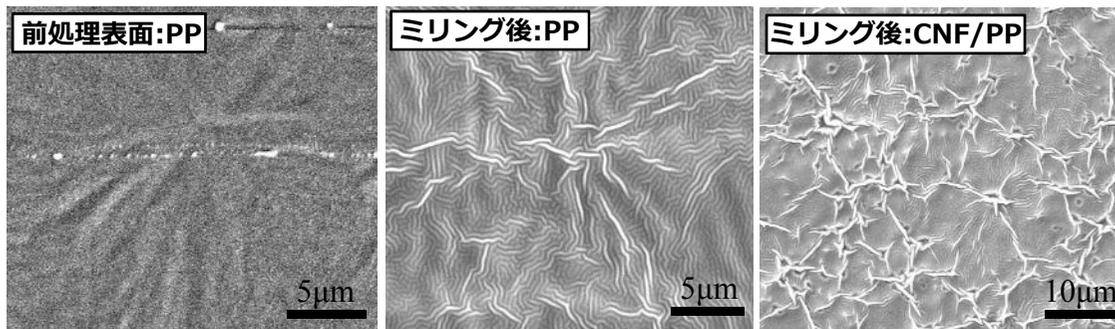
試料表面にアルゴンイオンを照射して試料原子を弾き飛ばすことで、任意の試料観察面(断面または表面)の加工・調整ができる装置です。熱ダメージを抑制するために、低温で加工する機能も有しています。

メーカー・型式

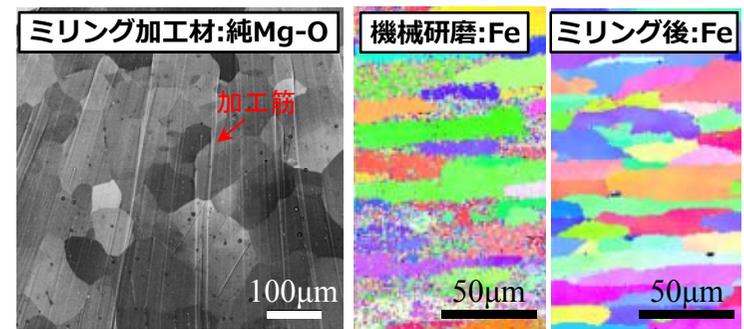
- ・メーカー : 株式会社日立ハイテクノロジーズ
- ・型式 : IM4000 PLUS

<主な仕様>

- ・最大試料サイズ : 20^w×12^d×7^tmm (断面加工)
50^φ×25^hmm (表面加工, 埋込試料等)
- ・最大加工レート : 500μm/hr (Si, 断面加工)
- ・温度調節範囲 : -100~0℃ (断面加工のみ)



ポリプロピレン(PP)とセルロースナノファイバー(CNF)複合化プラスチック材料の観察結果



金属材料の組織写真と結晶方位解析結果